

[首页](#)[机构](#)[成果](#)[学者](#)

中国科学院机构知识库网格

Chinese Academy of Sciences Institutional Repositories Grid

[登录](#) [注册](#)

CAS IR Grid / 金属研究所 / 中国科学院金属研究所

在连续纤维丝/条带表面高速均匀沉积薄膜的装置和方法

文献类型: 专利

入库方式: OAI收割

来源: [金属研究所](#)

浏览

102

下载

0

收藏

0

作者 雷浩, 肖金泉, 宫骏 and 孙超**发表日期** 2012-07-04**专利国别** 中国**专利类型** 发明专利**权利人** 中国科学院金属研究所

中文摘要 本发明属于薄膜制备领域,具体地说是一种在连续纤维丝/条带表面高速均匀沉积金属/化合物薄膜的装置和方法,解决了在纤维丝/条带表面高速均匀沉积薄膜的问题。该装置由两组四面矩形或正方形非平衡态磁控靶材和两个相同的带孔遮蔽板组成的真空封闭长方体或立方体连接两个张力可控的卷绕工件转架于内的真空腔体组成。非平衡态磁控溅射靶由中频脉冲/直流电源驱动,并在封闭的长方体或立方体内产生高密度等离子体,连续纤维丝/条带直接从高密度等离子体中穿过,等离子体均匀地环绕在纤维丝/条带的周围,整个纤维丝/条带的表面同时被均匀地沉积上纳米薄膜。本发明可实现在纤维丝/条带材料上的高速均匀地镀膜,拓展了磁控溅射镀膜的应用范围。

公开日期 2012-07-04**语种** 中文**专利申请号** CN102534535A**源URL** [<http://210.72.142.130/handle/321006/67970>] **专题** 金属研究所_中国科学院金属研究所**推荐引用方式** 雷浩, 肖金泉, 宫骏 and 孙超. 在连续纤维丝/条带表面高速均匀沉积薄膜的装置和方法. 2012-**GB/T 7714** 07-04.[其他版本](#)

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。

[» 欧盟学术资源开放存取平台](#) | [» CALIS高校机构知识库](#) | [» 台湾学术机构典藏](#) | [» 香港机构知识库整合系统](#) | [网站地图](#) | [意见反馈](#)

□ 版权所有 ©2023 中国科学院 - 运行维护: 中国科学院兰州文献情报中心/中国科学院西北生态环境资源研究院 - Powered by CSpace



0931-8270076 发送邮件

陇ICP备2021001824
号-8

甘公网安备 62010202001088号